

名古屋大学低温プラズマ科学研究センター 教員公募

1. 募集人員：助教1名
2. 任期：5年（1回のみ再任可）
3. 専門分野：プラズマナノプロセス分野
4. 所属：名古屋大学低温プラズマ科学研究センター
（工学部電気電子情報工学科および工学研究科電子工学専攻兼任）
5. 応募資格：博士の学位を有し、プラズマナノプロセス分野の研究に対して強い熱意・意欲と優れた能力を持ち、当該分野を主導できる方。電気電子情報工学科および電子工学専攻の学部生・大学院生の教育をおこなえる方
6. 担当科目：電気電子情報工学に関する学部生の学生実験・演習，学部生・大学院生の研究指導
7. 待遇：東海国立大学機構職員就業規則の定めるところによる
https://education.joureikun.jp/thers_ac/act/frame/frame110010928.htm
給与は東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程による
https://education.joureikun.jp/thers_ac/act/frame/frame110001585.htm
8. 着任時期：令和6年10月1日以降なるべく早い時期
9. 提出書類 (1) 履歴書(形式自由，写真添付，e-mail アドレスを含む連絡先記載)
(2) 研究業績リスト(①著書，②査読付き論文，③国際会議論文，④総説・解説，⑤特許，⑥基調講演・招待講演，に分けて記載)
(3) 主要論文の別刷(3編，コピー可)
(4) これまでの研究概要(A4版2ページ程度)
(5) 今後の研究計画及び教育についての抱負(A4版2ページ程度)
(6) 応募者について照会可能な方(2名)の氏名・所属・連絡先
(7) 審査に役立つと応募者が判断するその他の事項(著書・主な論文の被引用回数，h-index，受賞，競争的研究費の状況(代表，分担)，教育歴，社会活動など)
※それぞれPDF形式のファイルをUSBメモリに格納し，プリントアウト1部を添えて提出すること
10. 応募締切：令和6年5月7日(火)必着
11. 選考方法：書類審査により候補者を選考し，面接を行う。選考結果は，決定次第，通知する。
12. 書類送付先：〒464-8603 名古屋市千種区不老町
名古屋大学低温プラズマ科学研究センター
センター長 大野 哲靖
※ 書留で「低温プラズマ科学研究センター教員応募書類在中」と朱書明記すること。
13. 問い合わせ先：名古屋大学低温プラズマ科学研究センター
センター長 大野 哲靖 ohno@ees.nagoya-u.ac.jp
14. その他：
 - ・ 選考の過程で追加の資料を求められることがあります。
 - ・ 応募書類（USBメモリを含む）は返却しませんので，あらかじめご了承ください。
 - ・ 提出書類に含まれる個人情報は，選考および採用以外の目的には使用しません。
 - ・ 本学は積極的に男女共同参画を推進しています。
 - ・ 本公募は国際公募です。

- 面接に要する交通費は支給しません。
- 安全保障輸出管理の「みなし輸出」の改訂に係る手続きについて
2021年11月「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づく「みなし輸出」における管理対象の明確化に伴い、大学・研究機関における教職員への機微技術の提供の一部が外為法の管理対象となりました。
これに伴い、「類型該当判断のフローチャート」に基づく「類型該当性の自己申告書」の提出が必要となります。該当者には後日連絡します。また、採用時には「誓約書」の提出が必要となります。

Full Assistant Professor at Center for Low-temperature Plasma Science (cLPS),
Nagoya University

1. Number of Positions: One assistant professor
2. Term of office: 5 years (may be reappointed once only)
3. Affiliation: Center for Low-temperature Plasma Sciences, Nagoya University.
The assistant professor will also be in charge of education at the Department of Electrical Engineering, Electronics, and Information Engineering, School of Engineering, as well as Department of Electronics, Graduate School of Engineering.
4. Research Field: Plasma Nano-process
5. Qualifications: Holder of a Ph. D degree, Excellent ability of research in the field of Plasma Nano-process, Ability to manage the cLPS, Teaching undergraduate- and graduate-level students.
6. Subject of Teaching: Electronic Engineering (especially Plasma Nano-process and related subjects).
7. Salary and benefits
 - Salary, working hours, and benefits are determined in accordance with the provisions of the Tokai National Higher Education and Research System Employee Work Rules.
https://education.joureikun.jp/thers_ac/act/frame/frame110010928.htm (Japanese only)
 - Salary is determined based on the annual salary system at Nagoya University.
https://education.joureikun.jp/thers_ac/act/frame/frame110001585.htm (Japanese only)
8. Expected Starting Date: Earliest possible date after Oct. 1, 2024
9. Application Documents: Send a set of the following items by mail to the address below with a note
 - (1) Curriculum vitae with face photograph
 - (2) List of publications
 - (3) Reprints of five representative publications
 - (4) Summary of research achievements (about two pages)
 - (5) Research plan and essay on applicant's policy on education (about two pages)
 - (6) Name, affiliation, and e-mail address of two contact references
 - (7) Other items the applicant considers useful for selection (number of citations, h-index, awards, grants, education experiences, social activities, etc.)# Submit a USB memory stick containing the files in PDF format and one printout of each.
10. Deadline: May 7, 2024 (Deadline for receipt)
12. Selection Process: After document screening, we will have an individual interview. The selection result will be informed when a final candidate is decided.
13. Mailing Address: Prof. Noriyasu Ohno,
Center for Low-temperature Plasma Sciences, Nagoya University
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8601, Japan
- ※N.B. Send the letter in registered mail. Write "Application form for Assistant Professor Position at cLPS" in red on the envelope. Both application form and USB memory stick will not be returned to you.
14. Contact: Prof. Noriyasu Ohno,
E-mail: ohno (at) ees.nagoya-u.ac.jp
15. Remarks:

- Additional materials may be requested during the selection process.
- Please note that application documents (including USB memory stick) will not be returned.
- Personal information contained in the submitted documents will not be used for any purpose other than selection and employment.
- The University actively promotes gender equality.
- This is international recruitment.
- Transportation expenses for interviews will not be provided.
- In November 2021, with the clarification of the scope of control of "deemed exports" under the Foreign Exchange and Foreign Trade Act ("FEFTA"), a portion of the provision of confidential information must comply with FEFTA. Technology provided by universities and research institutions to faculty and staff is FEFTA is subject to control. As a result of this change, faculty applications will also be subject to FEFTA controls. In accordance with this change, you will be required to submit an Applicable Specific Category Determination Form according to the Applicable Specific Category Determination Flowchart. Eligible applicants will be notified in advance. In addition, faculty members are required to submit a "Confirmation Form" at the time of employment.